

標準技術集「MRAM・スピンメモリ技術」語彙集

略号	full spell	訳
AFM	Antiferromagnet	反強磁性
AFM	Atomic Force Microscope	原子間力顕微鏡
AMR	Anisotropic Magneto-Resistance	異方的磁気抵抗効果
BEC	Bottom Electrode Contact	下部電極接点
CAIE	Chemical Asisuted Ion Etching	ケミカルアシステッドイオンエッチング
CIMS	Current-Induced Magnetization Switchin	磁化スイッチング
CIP	Current in Plane	GMR膜面に平行な電流が流れる
CPP	Current Perpendicular to the Plane	GMR膜面に垂直な方向に電流が流れる
CMR	Colossal Magnetoresistance	コロサル磁気抵抗効果
DTJ	Double Tunneling Junction	二重トンネル構造
ESPV	Exchange-biased SPV	交換結合型スピバルブ
FIB	Focused Ion Beam	フォーカスイオンビーム
GMR	Giant Magneto-Resistance	巨大磁気抵抗
IBD	Ion Beam Deposition	イオンビーム堆積技術
IBS	Ion Beam Sputter	イオンビームスパッタ
ICP	Inductively Coupled Plasma Assisted	誘導結合プラズマ
IETS	INELASTIC ELECTRON TUNNELING SPECTROSCOPY	非弾性電子トンネル分光法
LLG	Landau-Lifshitz-Gilbert	ランド・リフシッツ・ギルバート方式
LSMO	La _{0.7} Sr _{0.3} MnO ₃	ペロブストカイト型マンガン酸化物の一つ
MBE	Molecular Beam Epitaxity	分子線エピタクシー
MCD-PEEM	Magnetic Circular Dichroism Photoemission Electron Microscope	二色性光電子顕微鏡
MFM	Magnetic Force Microscopy	磁力顕微鏡
MR	Magnetoresistive	磁気抵抗
MRAM	Magnetoresistive Random Access Memory	不揮発性磁気メモリ
MTJ	Magnetic Tunnel Junction	磁気トンネル接合
PSV	Pseudo-Spin Valve	擬スピバルブ
PECVD	Plasma Enhanced Chemical Vapor deposition	プラズマ化学気相堆積
RIE	Reactive Ion Etching	反応性ドライエッチング
SET	Single Electron Tunneling	単電子トンネル
SDT	Spin Dependant Tunneling	スピン依存トンネル
SMT	Spin Momentum Transfer	スピン注入磁化反転法
SRAM	Static Random Access Memory	揮発性メモリ
SSDT	Sandwich Spin Dependent Tunneling	サンドイッチSDT
STJ	Single Tunneling Junction	トンネル抵抗素子
STO	SrTiO ₃	酸化ストロンチウムチタン
SV	Spin Valve	スピバルブ
SyAF	Synthetic antiferromagnet	反平行結合膜
TMJ	Tunneling Magnetic Junction	トンネル抵抗素子
TMR	Tunneling Magnetoresistance	トンネル抵抗
VMRAM	Vertical MRAM	垂直MRAM